

# POLISHING 研磨与抛光 磨抛机 MACHINE

## MP系列研磨抛光机



▲ MP-2B 型研磨抛光机



▲ MP-1B 型研磨抛光机

本系类机型采用变频器调速，可使磨抛盘的转速在50-1000r/min之间无级可调，更换金相砂纸和抛光织物可分别进行磨、抛工序的操作，从而使本机展现了更加广泛的应用性。具有转动平稳、安全可靠、结构紧凑和噪音低等特点，且带有水冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织；其适用于对金相试样进行粗磨、精磨、粗抛光至精抛光的制样，是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

### ▼ 技术参数

	MP-1B	MP-2B
磨抛盘直径	φ 203mm	φ 203mm
磨抛盘转速	50-1000r/min	50-1000r/min
输入电压	单相 AC220V 50Hz	单相 AC220V 50Hz
磨抛盘数量	1	2
输入功率	250W	550W
外形尺寸	740 × 400 × 310mm	725 × 710 × 310mm
净 重	20kg	50kg

★ 获外观设计专利

# POLISHING 研磨与抛光 磨抛机 MACHINE

## MP系列研磨抛光机



▲ MP-2 型金相试样磨抛机



▲ M-2 型金相试样磨抛机



▲ M-1 型金相试样磨抛机

MP-2型金相试样磨抛机为双盘台式机，左盘用于研磨，右盘用于抛光，可以两人同时操作使用。本机具有转动平稳、安全可靠、结构紧凑和噪音低等特点，且带有水冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织，适用于对金相试样进行粗磨、精磨、粗抛光至精抛光的制备。

金相试样预磨机带有水冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织；适用于对金相试样进行粗磨、半精磨、精磨的制样，供进一步抛光后进行组织的显微测定，另有单盘机型M-1可供选择。

### ▼ 技术参数

	MP-2	M-2	M-1
磨抛盘直径	Φ203mm	Φ203mm	Φ203mm
输入功率	370W	370W	370W
磨抛盘转速	450 r/min (左)、600 r/min (右) (或根据用户要求订制)	450r/min	450r/min
输入电压	单相 AC220V 50Hz	单相 AC220V 50Hz	单相 AC220V 50Hz
净 重	40kg	40kg	28kg
外形尺寸	725mm × 710mm × 310mm	725mm × 710mm × 310mm	725mm × 400mm × 310mm

★ 获外观设计专利